

平成25年度 電子顕微鏡講習会 (非生物系)

エコトピア科学研究所 超高压電子顕微鏡施設

当施設では、文科省ナノテクノロジープラットフォーム、微細構造解析プラットフォーム「高性能電子顕微鏡による反応科学・ナノ材料科学研究支援拠点」プロジェクトにおいて、透過型電子顕微鏡を企業、大学、公設試等の学外研究者を対象として、電子顕微鏡講習会を下記要領で実施します。

「超高压電子顕微鏡施設利用申請書」にご記入の上、電子メールに添付して送信してください。

講習会後の機器利用のための実技講習希望者は、別途ご案内をいたしますので、メールにお書き添えください。

また、技術相談も承りますので、ご希望の方は申請書の「利用を希望する内容」の「技術相談」にチェックをいれて、講習会申込とは別の用紙に、研究課題名・目的・概要をご記入の上、お申し込みくださるようお願い申し上げます。技術相談は無料です。

記

講 義 : 電子顕微鏡の基礎

日 時 : 平成25年 7月25日 (木) 9:30 ~ 16:00

9:30 ~ 11:00	電子顕微鏡概論	量子工学専攻	山本 剛久 教授
11:00 ~ 11:30	反応科学超高压電子顕微鏡	エコトピア科学研究所	荒井 重勇 特任准教授
13:00 ~ 14:30	TEM 結像理論	エコトピア科学研究所	田中 信夫 教授
14:30 ~ 16:00	S/TEM による分析	エコトピア科学研究所	武藤 俊介 教授
16:10 ~ 17:00	超高压電子顕微鏡施設見学 (希望者のみ・当日受付)		

場 所 : ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー (VBL) 3階 ベンチャーホール

定 員 : 20名程度 (申込者多数の場合は調整することがあります)

受 講 料 : 無 料

申 込 期 限 : 平成25年 7月15日 (月) まで

申 込 先 : 「超高压電子顕微鏡施設」
利用申請書に御記入の上、E-mail でお申込み下さい。
※同一企業/大学等で複数人申し込みの場合には、
別紙「本研究従事者」欄にご記入ください。
E-mail innovation@esi.nagoya-u.ac.jp

問い合わせ先 : TEL : 052-789-3632
E-mail : innovation@esi.nagoya-u.ac.jp
(事務局 中野 まで)

I D (施設にて記入)

平成 年 月 日

超高压電子顕微鏡施設利用申請書

名古屋大学エコトピア科学研究所
超高压電子顕微鏡施設長 殿

下記のとおり貴施設の電子顕微鏡施設を利用したいので、名古屋大学エコトピア科学研究所超高压電子顕微鏡施設利用許可条件を承諾の上、申請します。

(利用者)

所属：	氏名：		
職名：	電話：	FAX：	
E-mail：	住所：〒		
所属機関区分：	年齢層：		
[研究・開発者] <input type="checkbox"/> 大企業 <input type="checkbox"/> 中小企業 <input type="checkbox"/> 公的研究機関 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 20代以下 <input type="checkbox"/> 30代		
[ポスドク] <input type="checkbox"/> 大企業 <input type="checkbox"/> 中小企業 <input type="checkbox"/> 公的研究機関 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 40代 <input type="checkbox"/> 50代以上		
[学生] <input type="checkbox"/> 大学院 <input type="checkbox"/> 大 学 <input type="checkbox"/> 高等専門学校 <input type="checkbox"/> その他			

利用区分： <input type="checkbox"/> 有償 <input checked="" type="checkbox"/> 無償 (トライアル)	
研究課題名： 電子顕微鏡講習会	
利用の目的： 電子顕微鏡講習会	
研究概要： 電子顕微鏡講習会	
利用期間：平成 25 年 7月 25日から平成 25 年 7月 25日まで	本研究従事者：別紙のとおり
成果の公開・非公開の選択： <input checked="" type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 非公開	
利用を希望する内容： 1. <input type="checkbox"/> 技術代行 (受託) <input type="checkbox"/> 観察・分析 <input type="checkbox"/> 試料作製 <input type="checkbox"/> データ解析 <input type="checkbox"/> 技術相談 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (7/25講習会) 2. <input type="checkbox"/> 技術補助 (オペレータ有) <input type="checkbox"/> 機器利用 (オペレータ無) 3. <input type="checkbox"/> 共同研究	
利用を希望する電子顕微鏡名 (複数選択可)： <input type="checkbox"/> 反応科学超高压電子顕微鏡 (JEM-1000K RS) <input type="checkbox"/> 収差補正電子顕微鏡 (EM-10000BU) <input type="checkbox"/> 電界放出型電子顕微鏡 (HF-2000) <input type="checkbox"/> 三次元観察電子顕微鏡 (Tecnai G2 Polara) <input type="checkbox"/> 電子分光電子顕微鏡 (JEM-2100M) <input type="checkbox"/> 集束イオンビーム加工機 <input type="checkbox"/> 超高压電子顕微鏡 (H-1250ST) <input type="checkbox"/> 汎用電子顕微鏡 (H-800) <input type="checkbox"/> 分析電子顕微鏡 (H-9000NAR) <input type="checkbox"/> 収差補正電子顕微鏡 (JEM-2100F) <input type="checkbox"/> 高分解能電子顕微鏡 (EM-002B) <input type="checkbox"/> 高分解能分析電子顕微鏡 (JEM-2010) <input type="checkbox"/> 生物用電子顕微鏡 (H-7600) <input type="checkbox"/> 走査電子顕微鏡 (Quanta200FEG)	
試料の種類： <input type="checkbox"/> 生物試料 <input type="checkbox"/> 金属 <input type="checkbox"/> セラミックス <input type="checkbox"/> 半導体 <input type="checkbox"/> 有機材料 <input type="checkbox"/> その他 ()	
試料の個数： () 個	
試料の形状・特徴： (危険性の有無、成分や大きさなどを具体的に記入)	
利用希望マシンタイム： () 回、一回あたり () 日	

本 研 究 従 事 者

氏 名	所属・職名	本研究における役割	電顕使用経験
		講習会参加	

※研究代表者は氏名の前に※を付すこと。

※電顕使用経験：(a)分析電子顕微鏡などの特殊操作も含めて経験がある。(b)簡単な操作の経験がある。
(c)ほとんど経験がない